

Germany-Neubiberg: Miscellaneous general and special-purpose machinery

OJ S 89/2023 08/05/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Universität der Bundeswehr München

Postal address: Werner-Heisenberg-Weg 39

Town: Neubiberg

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Postal code: 85579

Country: Germany

Contact person: ZV I.3

E-mail: unibwmuenchenzvi.3@bundeswehr.org

Telephone: +49 8960043243

Fax: +49 8960044013

Internet address(es):

Main address: <http://www.evergabe-online.de/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=516423>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Lehre und Forschung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Lieferung einer Sputteranlage mit Loadlock-Kammer

Reference number: M/HSB1/NT091/EIT2.1/DTEC_HW

II.1.2. Main CPV code

42900000 Miscellaneous general and special-purpose machinery

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Die Universität der Bundeswehr plant im Rahmen des DTEC Projekts die Beschaffung einer Sputteranlage mit Loadlock-Kammer. Dabei wird ein erprobtes System gesucht, um metallische und dielektrische Schichten mittels sputtern aufzubringen. Die Anlage soll dabei so flexibel sein, dass eine Erweiterung für eine ESV-Verdampfung oder zusätzlichen Targets ohne weiteres oder größeren finanziellen Aufwand möglich ist. Als Substrate werden Siliziumwafer mit den Durchmessern 100 mm und 150 mm verwendet. Dabei werden auch doppelseitig polierte Wafer eingesetzt. Des Weiteren muss es auch möglich sein Bruchstücke bzw. Chips in der Anlage zu prozessieren.

Im Bereich der Halbleitertechnologie ist das Aufbringen von metallischen und dielektrischen Schichten ein wichtiger Bestandteil. Dabei werden Sputteranlagen eingesetzt.

Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf die Qualität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse (Homogenität, Reproduzierbarkeit, Schichtdicke) gerichtet. Die Anlage sollte bedienerfreundlich sein, um möglichst einfach und zügig die nötigen Wafer zu bearbeiten. Neben den prozessrelevanten Details der Anlage ist ebenso die sichere Anwendung für den Bediener zu beachten. Hierbei gilt es zu gewährleisten, dass ein erhöhtes Gefahrenpotential durch mechanische sowie chemische Komponenten ausgeschlossen wird.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 523 210,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Main site or place of performance: Siehe Verzeichnis der Empfängeranschriften

II.2.4. Description of the procurement

Die Universität der Bundeswehr plant im Rahmen des DTEC Projekts die Beschaffung einer Sputteranlage mit Loadlock-Kammer. Dabei wird ein erprobtes System gesucht, um metallische und dielektrische Schichten mittels Sputtern aufzubringen. Die Anlage soll dabei so flexibel sein, dass eine Erweiterung für eine ESV-Verdampfung oder zusätzlichen Targets ohne weiteres oder größeren finanziellen Aufwand möglich ist. Als Substrate werden Siliziumwafer mit den Durchmessern 100 mm und 150 mm verwendet. Dabei werden auch doppelseitig polierte Wafer eingesetzt. Des Weiteren muss es auch möglich sein, Bruchstücke bzw. Chips in der Anlage zu prozessieren.

Im Bereich der Halbleitertechnologie ist das Aufbringen von metallischen und dielektrischen Schichten ein wichtiger Bestandteil. Dabei werden Sputteranlagen eingesetzt.

Ein Hauptaugenmerk wird auf die Qualität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse (Homogenität, Reproduzierbarkeit, Schichtdicke) gerichtet. Die Anlage sollte

bedienerfreundlich sein, um möglichst einfach und zügig die nötigen Wafer zu bearbeiten.

Neben den prozessrelevanten Details der Anlage ist ebenso die sichere Anwendung für den Bediener zu beachten. Hierbei gilt es zu gewährleisten, dass ein erhöhtes Gefahrenpotential durch mechanische sowie chemische Komponenten ausgeschlossen wird.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 04/09/2023 End: 30/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):

a) Formlose, unterschriebene Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass:

- keine Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123, 124 GWB vorliegen bzw. erfolgreiche

Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne von § 125 GWB durchgeführt worden sind,

- der Bieter in das einschlägige Berufsregister oder ein vergleichbares Register

(Standeskammern etc.) des Herkunftslandes eingetragen ist sowie für seine

Berufshaftpflichtversicherung, seine Krankenkasse(n) und seine Berufsgenossenschaft

rückstandlos Beiträge entrichtet hat.

b) Bietergemeinschaften sollen zusätzlich eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass kein Verstoß gegen Kartellrecht vorliegt (z.B. durch Angabe der Gründe, die zur Bildung der Bietergemeinschaft geführt haben) und dass keine unzulässigen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen getroffen wurden. Die Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter zulässig. Hierzu ist eine von allen Mitgliedern unterschriebene Vollmacht mittels einer

Bewerbergemeinschaftserklärung vorzulegen. Außerdem haben sämtliche Mitglieder der

Bietergemeinschaft namentlich mit Anschrift einen bevollmächtigten Vertreter für das

Vergabeverfahren sowie Abschluss und Durchführung des Vertrages zu bezeichnen. Bei der Eignungsprüfung wird die

Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Bietergemeinschaften müssen eine(n) einzige(n) Ansprechpartner(in) benennen.

c) Der Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):

a)Angabe der Gesamtumsätze der letzten bis zu 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, möglichst durch Jahresabschlüsse und Prüfberichte belegt, sowie die Angabe der Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre mit Leistungen, die mit dem vorliegenden Auftragsgegenstand vergleichbar sind (Lieferung einer Sputteranlage mit Loadlock-Kammer).

b)Der Auftraggeber behält sich vor, Unterlagen im Rahmen des § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Hierauf besteht kein Rechtsanspruch.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Mit dem Angebot sollen die Bieter möglichst folgende Unterlagen vorlegen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied):

a)Formlose, unterschriebene Eigenerklärungen, dass die von dem Bieter gelieferten Sputteranlage mit Loadlock-Kammer mit RoHs und REACH übereinstimmen.

b)Formlose, unterschriebene Eigenerklärung, dass die von dem Bieter gelieferten Sputteranlage mit Loadlock-Kammer keine Teile beinhalten, die den Regelungen des internationalen Waffenhandels (ITAR) unterfallen.

c)Liste von 5 Referenzen der vom Bewerber in den letzten fünf Jahren erbrachten Leistungen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Angabe des genauen Auftrags, der Auftragssumme, des Auftraggebers, der Leistungsart und Leistungszeiträume, der Referenzen mit Ansprechpartnern inkl. Tel.-Nr

Geforderte Mindeststandards:

Aus den eingereichten Referenzen muss sich ergeben, dass der Bieter in den letzten fünf Jahren mindestens fünf vergleichbare Sputteranlagen mit Loadlock-Kammern geliefert hat. Davon müssen 3 Referenzen aus Deutschland sein.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/06/2023 Local time: 13:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 26/07/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 13/06/2023 Local time: 13:00

Information about authorised persons and opening procedure: entfällt

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

1. Mehrfachangeobte, als Einzelbieter sowie als Mitglied einer/mehrerer Bietergemeinschaften, sind nicht zulässig. Die Angaben zur Zusammensetzung der Bietergemeinschaften sind grundsätzlich bindend. Ein Austausch einzelner Mitglieder der Bietergemeinschaft vor Auftragsvergabe bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

2. Der Angebotspreis darf maximal 523,210,00 € (Netto) betragen. Die UniBw M behält sich vor, Angebote, die den Kostenrahmen überschreiten vom Verfahren auszuschließen, sowie das Verfahren teilweise oder insgesamt aufzuheben, sollten ausschließlich Angebote oberhalb des Kostenrahmens eingehen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 2289499-0

Fax: +49 2289499-163

Internet address: <https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Das Verfahren für Verstöße gegen diese Vergabe richtet sich nach den Vorschriften der §§ 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zur Wahrung der Fristen wird auf die §§ 160 ff. GWB verwiesen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen ist. Vergabeverstöße sind nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB vor Einreichen des Nachprüfungsantrags innerhalb von 10 Kalendertagen, nachdem der Bieter den Verstoß erkannt hat, beim Auftraggeber zu rügen. Vergabeverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist bei dem Auftraggeber zu rügen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/05/2023